



(10) **DE 10 2011 007 756 A1** 2012.10.25

(12) **Offenlegungsschrift**

(21) Aktenzeichen: **10 2011 007 756.1**

(22) Anmeldetag: **20.04.2011**

(43) Offenlegungstag: **25.10.2012**

(51) Int Cl.: **G01B 7/02 (2006.01)**

G11B 5/667 (2006.01)

G01D 5/244 (2006.01)

(71) Anmelder:

**Dr. Johannes Heidenhain GmbH, 83301,
Traunreut, DE**

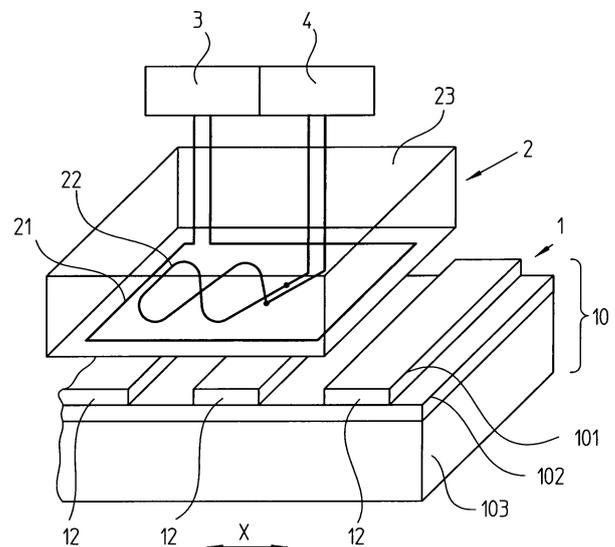
(72) Erfinder:

**Frank, Alexander, 83278, Traunstein, DE;
Tiemann, Marc Oliver, Salzburg, AT; Heumann,
Martin, Dr., 83278, Traunstein, DE**

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: **Positionsmesseinrichtung sowie Maßstab und Verfahren zur Herstellung eines Maßstabs**

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft eine Positionsmesseinrichtung mit einem induktiv abtastbaren Maßstab (1). Die Positionsmesseinrichtung weist eine Abtasteinheit (2) zur Abtastung von Teilungselementen (12) des Maßstabs (1) auf, hierzu weist die Abtasteinheit (2) eine Erregereinheit (21) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wechselfeldes sowie eine Detektoreinheit (22) zur Detektion des von den Teilungselementen (12) positionabhängig modulierten elektromagnetischen Wechselfeldes auf. Der Maßstab (1) besteht aus einem vorzugsweise durch Kaltwalzplattieren geschaffenen Schichtstapel (10) mit einem Substrat (103), das die mechanischen Eigenschaften des Maßstabs (1) maßgebend bestimmt, einer Trägerschicht (102) aus ferromagnetischem Material mit hoher Permeabilität und einer darauf befindlichen, die Teilungselemente (12) bildenden Teilungsschicht (101) aus elektrisch gut leitfähigem Material.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Maßstab mit einer induktiv abtastbaren Teilung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, ein Verfahren zur Herstellung dieses Maßstabs nach dem Oberbegriff des Anspruchs 14, sowie eine Positionsmesseinrichtung mit diesem Maßstab nach dem Anspruch 11.

[0002] Positionsmesseinrichtungen, die nach dem induktiven Messprinzip arbeiten, weisen einen Maßstab auf, der eine induktiv abtastbare Teilung besitzt. Die Teilung besteht aus einer Abfolge voneinander beabstandeter elektrisch leitfähiger Teilungselemente. Die Teilung wird im Messbetrieb von einer Abtasteinheit abgetastet, die zumindest eine Erregerwindung und eine Abtastwindung aufweist. Diese Windungen sind vorzugsweise flächig auf einer Leiterplatte aufgebracht. Ein an der Erregerwindung eingepprägter Erregerstrom generiert ein zeitlich wechselndes elektromagnetisches Erregerfeld, das durch die Anordnung der Teilungselemente positionsabhängig beeinflusst wird, wodurch in der Abtastwindung ein positionsabhängiges Abtastsignal induziert wird.

[0003] Induktiv abtastbare Maßstäbe und induktiv arbeitende Positionsmesseinrichtungen haben den Vorteil, dass sie relativ unempfindlich gegenüber Verschmutzungen sind. Sie sind insbesondere unempfindlich gegenüber Flüssigkeiten wie Wasser und Öle im Raum zwischen Maßstab und Abtasteinheit, weshalb sie sich besonders zur Winkel- und Längenmessung an Werkzeugmaschinen eignen.

[0004] In der EP 0 743 508 A2 wird ein induktiv abtastbarer Maßstab und eine induktive Positionsmesseinrichtung beschrieben. Es ist erläutert, dass die Teilungselemente aus einem Material mit hoher elektrischer Leitfähigkeit bestehen und auf einem Leiterplattenmaterial, beispielsweise FR4, aufgebracht sind. Das Leiterplattenmaterial eignet sich aufgrund seiner elektrischen Isolation besonders als Träger für die Teilungselemente. Aufgrund der mechanischen Nachteile des Leiterplattenmaterials wird in der EP 0 743 508 A2 vorgeschlagen, die Teilungselemente direkt auf ein Stahlsubstrat oder ein Invarsubstrat, also auf ein elektrisch leitendes Material aufzubringen, um die mechanische Stabilität zu verbessern.

[0005] Als Bedingung für die Verwendung eines Metallträgers wird in der EP 0 743 508 A2 angeführt, dass die elektrische Leitfähigkeit des Materials des Trägers nur sehr viel kleiner sein muss als die elektrische Leitfähigkeit des Materials der Teilungselemente. In der Praxis hat sich aber herausgestellt, dass bei der Verwendung von gebräuchlichem Stahl als Träger die Abtastsignale relativ gering sind, weshalb sich in der Praxis nur induktiv abtastbare Maßstäbe durchgesetzt haben, bei denen die Teilungselemente

auf einem elektrisch isolierenden Träger, insbesondere Leiterplattenmaterial, aufgebracht sind. Ein derartiger Maßstab ist aber in großen Längen schwierig herstellbar und aufgrund des Leiterplattenmaterials nicht resistent gegen Umgebungseinflüsse.

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen induktiv abtastbaren Maßstab anzugeben, der auch in relativ großen Längen einfach herstellbar ist, unempfindlich gegenüber Umgebungseinflüssen ist und bei der induktiven Abtastung gut auswertbare, also hohe Abtastsignale generiert.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch einen Maßstab mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0008] Der erfindungsgemäß ausgebildete Maßstab weist zumindest eine in Messrichtung verlaufende induktiv abtastbare Teilung auf, die aus einer in Messrichtung angeordneten Folge voneinander beabstandeter Teilungselemente besteht. Der Maßstab umfasst einen Schichtstapel, der ausschließlich aus einer Abfolge von metallischen Schichten besteht, wobei diese Abfolge von metallischen Schichten zumindest eine Trägerschicht und eine die Teilungselemente bildende Teilungsschicht aufweist. Die Trägerschicht ist zwischen der Teilungsschicht und einem metallischen Substrat angeordnet und besteht aus einem ferromagnetischen, insbesondere auch weichmagnetischen, Metall. Das Substrat ist derart dimensioniert, dass es maßgebend die mechanischen Eigenschaften des Schichtstapels bestimmt.

[0009] Vorzugsweise ist das Material der Trägerschicht ein ferromagnetisches Metall mit einer Permeabilität μ_r größer 200, besonders vorteilhaft ist die Verwendung eines Metalls mit einer Permeabilität μ_r größer 1000. Geeignete ferromagnetische Metalle sind insbesondere Mu-Metalle, dieses sind weichmagnetische Nickel-Eisen-Legierungen mit einem Nickelanteil von etwa 70–80%. Mu-Metalle werden unter dem Handelsnamen Mumetall vertrieben. Anstelle von Nickel-Eisen-Legierungen können auch andere Legierungen oder auch ferritische Stähle mit einer relativ hohen Permeabilität, insbesondere größer 200, Verwendung finden.

[0010] Bei der Erfindung wird die Tatsache ausgenutzt, dass bei der induktiven Abtastung Wechselfelder generiert werden und für die Effizienz eines Maßstabs nicht allein die elektrische Leitfähigkeit der Trägerschicht bedeutend ist, auf der die Teilungselemente aufgebracht sind. Ebenso bedeutend ist die Permeabilität des als Trägerschicht verwendeten Materials. Bei der Erfindung wird die von der Permeabilität des verwendeten Materials frequenzabhängige Eindringtiefe von Wirbelströmen genutzt. Vor allem bei hochpermeablen Werkstoffen ist die Eindringtiefe nämlich besonders klein. Je geringer die Eindringtiefe

fe, desto höher ist der wirksame Widerstand für Wirbelströme. Störende Wirbelströme, die sich von einem Teilungselement zu einem daneben angeordneten Teilungselement ausbilden, können somit unterdrückt werden. Bei der Verwendung von ferromagnetischen Metallen hoher Permeabilität spielt die elektrische Leitfähigkeit des Metalls eine untergeordnete Rolle.

[0011] Als Substrat wird vorzugsweise ein Edelstahl verwendet. Damit das Substrat maßgebend die mechanischen Eigenschaften des gesamten Schichtstapels und somit des Maßstabs bestimmt, beträgt die Dicke des Substrats ein Vielfaches der Dicke der Trägerschicht, insbesondere beträgt die Dicke des Substrats mehr als das 5 bis 20-fache der Dicke der Trägerschicht.

[0012] Durch das Vorsehen eines relativ dicken Substrats für die Schichtenfolge Trägerschicht und Teilungsschicht, wird dem Verbund aus allen Schichten die mechanische Eigenschaft des Substrats aufgeprägt. Durch diese Maßnahme können für die Trägerschicht Materialien mit sehr hoher Permeabilität eingesetzt werden, die dann auch relativ weich und mechanisch instabil sein können.

[0013] Die Materialien und Dickenverhältnisse werden vorzugsweise derart gewählt, dass der Schichtstapel und somit der Maßstab einen resultierenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten hat, der nur unwesentlich vom thermischen Ausdehnungskoeffizienten des Substrats abweicht, insbesondere nur um einen Wert von maximal $\pm 1 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ abweicht. Vorzugsweise hat das Substrat einen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von etwa $10 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ und der Maßstab somit einen resultierenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten von etwa $9 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ bis $11 \times 10^{-6} \text{K}^{-1}$.

[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist auf einer Seite des Substrats die Schichtenfolge Trägerschicht und Teilungsschicht vorgesehen und auf der anderen Seite des Substrats zumindest eine Kompensationsschicht, die einer Krümmung des Schichtstapels hervorgerufen durch den Bimetalleffekt entgegenwirkt. Diese Kompensationsschicht besteht vorzugsweise aus dem gleichen Metall wie die Trägerschicht, insbesondere auch aus einem ferromagnetischen Metall, das insbesondere eine Permeabilität μ_r größer 200, vorzugsweise größer 1000 aufweist.

[0015] Einen besonders innigen und stabilen Verbund der Schichten des Schichtstapels erhält man, wenn diese mittels Walzplattieren, insbesondere Kaltwalzplattieren, miteinander verbunden sind.

[0016] Ein derartiger Maßstab kann für Positionsmesseinrichtungen in Form von Winkelmesseinrich-

tungen und Längenmeseinrichtungen eingesetzt werden. Da ein derart aufgebauter Maßstab auch in Bandform leicht herstellbar ist, eignet er sich besonders für Längenmeseinrichtungen großer Länge. Ein erfindungsgemäß aufgebauter Maßstab in Bandform kann auch in vorteilhafter Weise in Winkelmesseinrichtungen eingesetzt werden, wenn er beispielsweise auf den Innen- oder Außenumfang einer Trommel aufgebracht wird. Zum klebenden Aufbringen des erfindungsgemäß ausgebildeten Maßstabs kann der Schichtstapel auf der Unterseite durch ein Klebemittel ergänzt sein, insbesondere ein Klebeband, das zur guten Handhabung als doppelseitiges Klebeband ausgeführt sein kann.

[0017] Mit der Erfindung soll weiterhin eine Positionsmesseinrichtung angegeben werden, die relativ unempfindlich gegen Umgebungseinflüsse ist und die gut auswertbare Abtastsignale generiert.

[0018] Eine derartige Positionsmesseinrichtung ist im Anspruch 11 angegeben.

[0019] Die Positionsmesseinrichtung weist demnach einen Maßstab mit einer in Messrichtung verlaufenden induktiv abtastbaren Teilung auf, die aus einer in Messrichtung angeordneten Folge voneinander beabstandeter Teilungselemente besteht. Dieser Maßstab umfasst einen Schichtstapel, der ausschließlich aus einer Abfolge von metallischen Schichten besteht, wobei diese Abfolge von metallischen Schichten zumindest eine Trägerschicht und eine die Teilungselemente bildende Teilungsschicht aufweist. Die Trägerschicht ist zwischen der Teilungsschicht und einem metallischen Substrat angeordnet und ist ein ferromagnetisches Metall, das insbesondere eine Permeabilität μ_r größer 200, vorzugsweise größer 1000 aufweist. Das Substrat ist derart dimensioniert, dass es die mechanischen Eigenschaften des Schichtstapels maßgebend bestimmt. Die Positionsmesseinrichtung umfasst ferner eine Abtasteinheit zur Abtastung der Teilung des Maßstabs, wobei die Abtasteinheit eine Erregereinheit zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wechselfeldes und eine Detektoreinheit zur Detektion des von den Teilungselementen positionsabhängig modulierten elektromagnetischen Wechselfeldes aufweist.

[0020] Die Erregereinheit wird vorzugsweise von zumindest einer flächigen Erregerwindung und die Detektoreinheit von zumindest einer flächigen Abtastwindung gebildet.

[0021] In einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung ist auf einer Seite des Substrats die Schichtenfolge Trägerschicht und Teilungsschicht vorgesehen und auf der anderen Seite des Substrats zumindest eine Kompensationsschicht, die vorzugsweise aus dem gleichen Material wie die Trägerschicht besteht und ein ferromagnetisches Metall ist. Die Abtas-

teinheit weist eine sie umgebende Abschirmung auf, wobei die Abschirmung derart ausgebildet ist, dass diese mit der Kompensationsschicht einen geschlossenen Magnetkreis ausbildet. Hierzu ist die Permeabilität μ_r des Metalls der Kompensationsschicht insbesondere größer 200, vorzugsweise größer 1000.

[0022] Eine weitere Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zur einfachen Herstellung eines gegen Umgebungseinflüsse unempfindlichen induktiv abtastbaren Maßstabs anzugeben.

[0023] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 14 gelöst.

[0024] Demnach wird der Maßstab durch Bilden eines rein metallischen Verbundes als Schichtstapel aus einer Abfolge metallischer Schichten geschaffen. Der Schichtstapel ist ein Verbund mit der Schichtfolge:

metallisches Substrat, Trägerschicht und Teilungsschicht,

wobei das Substrat derart dimensioniert ist, dass es die mechanischen Eigenschaften des Verbundes, also des Schichtstapels und somit des Maßstabs maßgebend bestimmt. Als Trägerschicht wird ein ferromagnetisches Metall, insbesondere ein weichmagnetisches Metall, vorzugsweise mit einer Permeabilität μ_r größer 200, besonders vorzugsweise mit einer Permeabilität μ_r größer 1000 verwendet.

[0025] Zur Schaffung eines Maßstabes für ein Längenmesssystem großer Länge wird der Schichtstapel aus Metallbändern gebildet, die mittels Walzplattieren, insbesondere mittels Kaltwalzplattieren miteinander verbunden werden.

[0026] Der so gebildete Schichtstapel lässt sich danach als Verbund weiter verarbeiten. Wenn es erforderlich sein sollte, kann eine Oberflächenbehandlung erfolgen und der Verbund kann beispielsweise durch Zuschnitt auf die erforderlichen Abmessungen gebracht werden. Die Teilungselemente werden durch bekannte Strukturierungsverfahren, wie beispielsweise einem photochemischen Ätzprozess, aus der Teilungsschicht gebildet.

[0027] Vorteile sowie Einzelheiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der beiliegenden Figuren.

[0028] Es zeigen

[0029] [Fig. 1](#) eine perspektivische Ansicht einer induktiven Positionsmesseinrichtung;

[0030] [Fig. 2](#) den Maßstab der Positionsmesseinrichtung gemäß [Fig. 1](#);

[0031] [Fig. 3a](#) einen ersten Verfahrensschritt zur Herstellung des Maßstabs;

[0032] [Fig. 3b](#) einen zweiten Verfahrensschritt zur Herstellung des Maßstabs;

[0033] [Fig. 4](#) eine weitere Ausgestaltung eines Maßstabs gemäß der Erfindung und

[0034] [Fig. 5](#) eine Positionsmesseinrichtung mit dem in [Fig. 4](#) dargestellten Maßstab.

[0035] In [Fig. 1](#) ist in einer perspektivischen Ansicht der prinzipielle Aufbau einer Positionsmesseinrichtung mit einem erfindungsgemäß ausgestalteten Maßstab **1** dargestellt. Der Maßstab **1** weist eine Teilung auf, die von einer ihr in geringem Abstand gegenüberliegenden Abtasteinheit **2** abtastbar ist. Zur Positionsmessung in Messrichtung X erfolgt eine Relativbewegung zwischen dem Maßstab **1** und der Abtasteinheit **2**. Die Teilung besteht aus einer periodischen Abfolge von in Messrichtung X voneinander beabstandeten elektrisch leitfähigen Teilungselementen **12**. Im dargestellten Ausführungsbeispiel sind die Teilungselemente **12** flächig und rechteckförmig ausgebildet, die Teilungselemente können aber auch andere Formen aufweisen, beispielsweise rund oder dreieckförmig. Weiterhin ist die vollflächige Form der Teilungselemente **12** nicht Bedingung, ein Teilungselement kann auch als geschlossene Windung ausgebildet sein. Wesentlich ist nur, dass sich jeweils in einem Teilungselement **12** Wirbelströme ausbilden können, die gegen ein von der Abtasteinheit **2** ausgehendes Erregerfeld wirken.

[0036] Die Abtasteinheit **2** ist in [Fig. 1](#) nur schematisch dargestellt, um die Funktion der Induktiven Abtastung beim Zusammenwirken mit dem Maßstab **1** zu erläutern. Die Abtasteinheit **2** weist zumindest eine Erregerinheit insbesondere in Form einer flächigen Erregerwindung **21** auf, die von einer Ansteuereinheit **3** mit einem Erregerstrom derart gespeist wird, dass ein zeitlich wechselndes elektromagnetisches Erregerfeld im Bereich der Teilungselemente **12** erzeugt wird. Dieser Erregerstrom weist beispielsweise eine Frequenz von einigen MHz auf. Die Erregerwindung **21** ist derart räumlich angeordnet, dass sie in der gegenüberliegenden Abfolge der Teilungselemente **12** ein möglichst homogenes elektromagnetisches Feld ausbildet.

[0037] Die Abtasteinheit **2** weist darüber hinaus zumindest eine Detektoreinheit insbesondere in Form einer flächigen Abtastwindung **22** auf. Die Ausführung und räumliche Anordnung der Erregerwindung **21** ist derart, dass in dem Bereich der Abtastwindung **22** ein möglichst homogener Feldverlauf erzeugt wird. Die Abtastwindung **22** befindet sich hierzu innerhalb der Erregerwindung **21**. Das von der Erregerwindung **21** generierte Erregerfeld generiert

in den Teilungselementen **12** Wirbelströme, die als Gegenfeld gegen das Erregerfeld wirken. In der Abtastwindung **22** wird aufgrund des ihr zugeordneten Erregerfeldes eine Spannung induziert, die von der relativen Lage zu den elektrisch leitenden Teilungselementen **12** abhängig ist. Die Teilungselemente **12** sind in Messrichtung X räumlich derart angeordnet, dass sie das Erregerfeld positionsabhängig beeinflussen. Die Erregerwindung **21** ist also mit der Abtastwindung **22** in Abhängigkeit der relativen Lage der Teilungselemente **12** in Messrichtung X induktiv gekoppelt. Das elektromagnetische Wechselfeld wird durch die Teilungselemente **12** in Messrichtung X positionsabhängig moduliert, dadurch variiert auch die in der Abtastwindung **22** induzierte Spannung positionsabhängig. Die in der zumindest einen Abtastwindung **22** induzierte Spannung wird einer Auswertereinheit **4** zugeführt, die daraus ein elektrisches positionsabhängiges Signal bildet.

[0038] Besonders vorteilhaft ist die Anordnung von Erregerwindung **21** und Abtastwindung **22** in Form von auf einem gemeinsamen Träger **23** aufgebrachten Leiterbahnen. Wie in [Fig. 1](#) schematisch dargestellt ist, sind diese Leiterbahnen auf der Seite des Trägers **23** angeordnet, die der Abfolge der Teilungselemente **12** in geringem Abtastabstand gegenüberliegt. Der Träger **23** kann beispielsweise als Leiterplatte ausgebildet sein. Dabei sind die Teilungselemente **12** des Maßstabs **1** vorzugsweise in einer Ebene angeordnet, die parallel zu der Ebene ausgerichtet ist, in welcher die Erregerwindung **21** und die Abtastwindung **22** verlaufen.

[0039] In nicht gezeigter Weise sind üblicherweise mehrere gegeneinander phasenversetzte Abtastwindungen in der Abtasteinheit **2** vorgesehen, um mehrere gegeneinander phasenverschobene Abtastsignale zu erzeugen, beispielsweise um 90° gegeneinander phasenverschobene Abtastsignale. Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist diese Ausgestaltung in [Fig. 1](#) nicht dargestellt.

[0040] Der Maßstab **1** ist aus einem Schichtstapel **10** gebildet, der aus einem metallischen Verbund, also aus einer Abfolge von metallischen Schichten **101**, **102**, **103** besteht, wie in [Fig. 2](#) näher dargestellt ist. Diese Ausgestaltung hat den besonderen Vorteil, dass der Maßstab **1** im Messbetrieb besonders unempfindlich gegenüber Umgebungsmedien ist. Die Schichten **101**, **102**, **103** des Schichtstapels **10** sind fest miteinander verbunden, also zueinander unverschieblich.

[0041] Die Abfolge der metallischen Schichten **101**, **102**, **103** des Schichtstapels **10** weist zumindest eine Trägerschicht **102** auf, die ein ferromagnetisches Metall ist. Dieses Metall ist vorzugsweise weichmagnetisch. Darüber hinaus ist die Permeabilität μ_r dieses Metalls möglichst hoch, insbesondere größer 200,

vorteilhafterweise größer 1000. Auf dieser durchgehenden Trägerschicht **102** ist eine Teilungsschicht **101** aufgebracht, welche nach erfolgter Strukturierung die in Messrichtung X voneinander beabstandeten Teilungselemente **12** des Maßstabs **1** bildet. Als Material für diese Teilungselemente **12** werden Metalle wie beispielsweise Kupfer, Aluminium, Silber, Gold oder diese Metalle enthaltende Legierungen verwendet. Das Material der Teilungselemente **12** weist eine hohe elektrische Leitfähigkeit auf, ist jedoch nicht ferromagnetisch. Die Permeabilität μ_r des Materials der Teilungsschicht **101** und somit der Teilungselemente **12** liegt bei etwa **1**.

[0042] Der Schichtstapel **10** umfasst weiterhin ein Substrat **103**, auf dem die Abfolge Trägerschicht **102** und Teilungsschicht **101** vorgesehen ist. Dieses Substrat **103** ist derart dimensioniert, dass es die mechanischen Eigenschaften des Schichtstapels **10** maßgebend bestimmt. Hierzu beträgt die Dicke des Substrats **103** ein Vielfaches, insbesondere das 5- bis 20-fache, der Dicke der Trägerschicht **102** sowie ein Vielfaches der Dicke der Teilungsschicht **101**. Die Dickenverhältnisse werden derart gewählt, dass der thermische Ausdehnungskoeffizient des Maßstab **1** vorwiegend vom Substrat **103** bestimmt wird.

[0043] Als Material für das Substrat **103** wird vorzugsweise rostfreier härtpbarer Edelstahl gewählt. Durch das Härten werden die mechanischen Eigenschaften verbessert, die Formstabilität und die Flexibilität werden erhöht. Wird ein Substrat **103** in Bandform verwendet, kann dieses zum Transport oder zur Lagerung aufgrund der Flexibilität des Bandes aufgerollt werden, ohne dass es zu plastischen Verformungen kommt. Durch die Schaffung eines festen Verbundes der Schichten **102** und **101** mit dem Substrat **103** werden diese vorteilhaften mechanischen Eigenschaften auf den gesamten Schichtstapel **10** und somit auf den Maßstab **1** übertragen.

[0044] Die unmittelbar unterhalb der Teilungselemente **12** angeordnete und durchgehende Trägerschicht **102** aus einem Material mit hoher Permeabilität hat den Vorteil, dass störende Wirbelströme, die sich von einem Teilungselement **12** zu einem daneben angeordneten Teilungselement **12** ausbilden, zumindest weitgehend unterdrückt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Dicke der Trägerschicht **102** abhängig vom gewählten Material ausreichend groß gewählt wird. Die Dicke soll ein Vielfaches, beispielsweise das 10-fache, der Eindringtiefe δ der Wirbelströme betragen:

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \cdot f \cdot \mu_0 \cdot \mu_r \cdot \sigma}}$$

mit

δ = Eindringtiefe (Tiefe, bei der der Strom auf ca. 37% des Oberflächenwertes gefallen ist)
 σ = spezifischer elektrischer Widerstand des Materials
 f = Frequenz
 μ_0 = Permeabilitätskonstante des Vakuums
 μ_r = relative Permeabilitätszahl des Materials

[0045] Wird beispielsweise als Trägerschicht **102** ein sogenanntes Mu-Metall, also beispielsweise eine Ni-Fe-Legierung mit etwa 80% Ni verwendet, gelten folgende Dimensionierungsregeln:

Permeabilität $\mu_r = 60000$

spezifischer elektrischer Widerstand: $0,55 \mu\Omega\text{m}$

Relevanter Frequenzbereich: 1 MHz bis 10 MHz (Beispielfrequenzen)

[0046] Abhängig von der daraus errechneten Eindringtiefe δ ergibt sich eine optimale Dicke der Trägerschicht **102**:

Eindringtiefe δ bei 1 MHz = $1,52 \mu\text{m}$

=> optimale Dicke $\approx 15 \mu\text{m}$ (10 fache Eindringtiefe δ)

Eindringtiefe δ bei 10 MHz = $0,48 \mu\text{m}$

=> optimale Dicke = $4,8 \mu\text{m}$ (10 fache Eindringtiefe δ)

[0047] Bei einer Dicke der Trägerschicht **102** von etwa $10 \mu\text{m}$ wird ein Substrat **103** mit einer Dicke von $50 \mu\text{m}$ bis $200 \mu\text{m}$ verwendet.

[0048] Bei einem einfach – insbesondere durch Walzplattieren – herstellbaren Maßstab **1** in Bandform, der auch gut handhabbar ist, beträgt die Dicke der Trägerschicht **102** maximal $50 \mu\text{m}$. Die Gesamtdicke des Schichtstapels **10** ist kleiner $1000 \mu\text{m}$, liegt insbesondere im Bereich von $500 \mu\text{m}$.

[0049] Da die relative Permeabilitätszahl μ_r des Materials der Trägerschicht **102** bei hohen Werten diesbezüglich die bestimmende Größe ist, ist die Größe der elektrischen Leitfähigkeit der Trägerschicht **102** nachrangig. Die Eindringtiefe δ ist in einem Material mit hoher Permeabilität besonders gering und das Material bildet für die Wirbelströme einen hohen Widerstand. Die metallische Trägerschicht **102** ist somit ein für die Wirbelströme wirkender Widerstand zwischen der Teilungsschicht **101** und dem Substrat **103**. Als Folge verbleiben die Wirbelströme zum größten Teil in den Teilungselementen **12** des Maßstabs **1**. Eine störende elektrisch leitfähige Verbindung zwischen den in Messrichtung X voneinander angeordneten Teilungselementen **12** liegt für die hochfrequenten Wirbelströme nicht mehr vor.

[0050] Die Anordnung der Trägerschicht **102** zwischen der Teilungsschicht **101** und dem Substrat **103** hat den Vorteil, dass bei der Auswahl des Materials für die Trägerschicht **102** vorrangig auf die magnetischen Eigenschaften geachtet werden kann. Die mechanischen Eigenschaften der Trägerschicht **102** sind nachrangig, da die mechanischen Eigenschaften

des Schichtstapels **10** vorrangig vom Substrat **103** bestimmt werden. Wird beispielsweise ein Substrat **103** in Bandform verwendet, kann der Maßstab **1** zum Transport oder zur Lagerung aufgrund der Flexibilität des bandförmigen Substrats **103** aufgerollt werden, ohne dass es zu plastischen Verformungen des Maßstabs **1** kommt. Die Verwendung eines die mechanischen Eigenschaften des Maßstabs **1** bestimmenden Substrats **103** hat nun den Vorteil, dass für die Trägerschicht **102** Materialien mit sehr hoher Permeabilität eingesetzt werden können. Diese Materialien haben nämlich in der Regel den Nachteil, dass sie relativ weich und leicht plastisch verformbar sind.

[0051] Die Schichten **101**, **102**, **103** des Schichtstapels **10** sind innig durch flächigen Kontakt zueinander unverrückbar miteinander verbunden, so dass der Schichtstapel **10** als Maßstab **1** handhabbar ist. Ein besonders vorteilhaftes Verfahren zur Herstellung ist das Walzplattieren, mit dem die Schichten **101**, **102**, **103** des Schichtstapels **10** untrennbar miteinander verbunden werden. Als Walzplattierverfahren kann das Warmwalzverfahren oder das Kaltwalzverfahren eingesetzt werden. Als Ergebnis erhält man eine bestens haftende Teilungsschicht **101** auf der Trägerschicht **102**. Darüber hinaus erhält man eine innige flächige Verbindung zwischen dem Substrat **103** und der Trägerschicht **102**. Diese innige Verbindung gewährleistet, dass die mechanischen Eigenschaften des Substrats **103** vorherrschen und auf die weiteren Schichten **101**, **102** des Schichtstapels **10** übertragen werden, insbesondere die Flexibilität und die thermischen Ausdehnungseigenschaften. Das Walzplattieren hat den Vorteil, dass besonders lange Maßstäbe **1** über mehrere Meter einfach hergestellt werden können, indem der Schichtstapel **10** aus Metallbändern hergestellt wird.

[0052] Zur Bildung des Schichtstapels **10** besonders geeignet ist das Kaltwalzplattieren. Es besteht aus einem Umformprozess, bei dem die gereinigten und ggf. vorbehandelten Schichten **101**, **102**, **103** in Form von Metallbändern gemeinsam in kaltem Zustand, also unterhalb der Rekristallisationstemperatur, gewalzt werden. Aufgrund der dabei auftretenden großen Drücke werden einerseits Dickenreduzierungen von 30 bis 60% erzielt und andererseits wird ein fester unlösbarer Verbund zwischen den einzelnen Schichten **101**, **102**, **103** untereinander geschaffen. Dieser innige Verbund resultiert aus Adhäsionskräften, mechanischen Verklammerungen der Oberflächen und metallischen Bindungen.

[0053] In [Fig. 3a](#) ist das Verfahren Kaltwalzplattieren zur Herstellung des Schichtstapels **10** schematisch dargestellt. Das Substrat **103**, die Trägerschicht **102** und die Teilungsschicht **101** liegen in Bandform vor und werden gemeinsam einer Walzvorrichtung **5** zugeführt, in der diese unter hohem Druck miteinander vereinigt werden.

[0054] Nach dem eigentlichen Walzvorgang schließt sich eine Glühbehandlung, auch Diffusionsglühen oder Haftungsglühen genannt, an. Bei dieser Wärmebehandlung erfolgt einerseits eine Materialrekristallisation und andererseits in den Verbindungszonen zwischen den einzelnen Schichten **101**, **102**, **103** eine weitere Verfestigung der Verbindung. In **Fig. 3b** ist eine derartige Glühbehandlung des gewalzten Schichtstapels **10** schematisch dargestellt. Der Schichtstapel **10** wird dabei durch eine Glühvorrichtung **6** geführt, in der der Schichtstapel einer hohen Temperatur **T** ausgesetzt wird.

[0055] Vorzugsweise folgt zumindest eine weitere Glühbehandlung. Wird als Substrat **103** Stahl gewählt, so kann dieser Stahl bei einer weiteren Glühbehandlung gehärtet werden. Desweiteren kann eine Glühbehandlung dazu dienen, die magnetischen Eigenschaften, wie z. B. die Permeabilität der Trägerschicht **102** zu optimieren.

[0056] Bei Bedarf können mehrere Walz- und Glühprozesse aufeinanderfolgend durchgeführt werden, um die gewünschten Parameter des Schichtstapels **10** zu erreichen.

[0057] Der so gebildete Schichtstapel **10** lässt sich danach als Verbund weiter verarbeiten. Wenn erforderlich, kann eine Oberflächenbehandlung erfolgen und der Verbund kann beispielsweise durch Zuschnitt auf die erforderlichen Abmessungen gebracht werden. Die Teilungselemente **12** werden durch bekannte Strukturierungsverfahren, wie beispielsweise einen photochemischen Ätzprozess, aus der Teilungsschicht **101** gebildet.

[0058] Nachfolgend wird eine weitere Ausgestaltung eines Maßstabs **1.1** erläutert. Zur Reduzierung von thermischen Verbiegungen des Maßstabs **1.1** ist ein symmetrischer Schichtaufbau des Schichtstapels **10.1** von besonderem Vorteil. Ein Beispiel dazu ist in **Fig. 4** dargestellt. Dabei ist auf die Rückseite des Substrats **103** eine Kompensationsschicht **104** aufgebracht, welche einer Verbiegung des Substrats **103**, hervorgerufen durch die einseitige Beschichtung mit der Trägerschicht **102** und der Teilungsschicht **101**, vermeiden soll. Insbesondere soll damit eine durch die Trägerschicht **102** eingeleitete Krümmung, hervorgerufen durch den Bimetalleffekt, verhindert bzw. zumindest weitgehend vermieden werden. In vorteilhafter Weise besteht zu diesem Zweck auch die auf der Rückseite des Substrats **103** aufgebrachte Kompensationsschicht **4** aus dem gleichen Material wie die Trägerschicht **102**. Die Dicke der Kompensationsschicht **104** wird derart gewählt, dass eine Krümmung des Substrats **103** vermieden wird. Die Dickenverhältnisse werden auch hier vorzugsweise derart gewählt, dass die mechanischen Eigenschaften und der thermische Ausdehnungsko-

effizient des Maßstabs **1.1** überwiegend vom Substrat **103** bestimmt werden.

[0059] Besonders vorteilhaft ist es, wenn der Schichtstapel **10.1**, bestehend aus der Teilungsschicht **101**, der Trägerschicht **102**, dem Substrat **103** und der Kompensationsschicht **104**, wiederum gemeinsam durch ein Walzverfahren, insbesondere das Kaltwalzverfahren, zu einem innigen Verbund zusammengefügt werden.

[0060] Wie in **Fig. 5** dargestellt ist, kann die Kompensationsschicht **104** auf der Rückseite des Substrats **103** zusätzlich dazu genutzt werden, um die Positionsmesseinrichtung vor externen magnetischen Störfeldern abzuschirmen. Um die Abtasteinheit **2** wird hierzu eine magnetische Abschirmung **7** angeordnet, welche bis in die Nähe der Kompensationsschicht **104** geführt ist. Die Abschirmung **7** besteht aus einem flussführenden Material, insbesondere auch weichmagnetischen Material, so dass zusammen mit der Kompensationsschicht **7** ein zumindest weitgehend geschlossener Magnetkreis **8** ausgebildet wird. Die Abschirmung **7** umgibt die Abtasteinheit und den Maßstab **1.1** U-förmig an drei Seiten. Die Abschirmung **7** erstreckt sich über die ferromagnetische Trägerschicht **102** und reicht zumindest weitgehend bis zur Kompensationsschicht **104**.

[0061] Sollte es für bestimmte Anwendungen erforderlich sein, so kann der Maßstab **1** bzw. **1.1** zusätzlich vor Umwelteinflüssen geschützt werden, indem zumindest die Oberseite des Maßstabs **1** bzw. **1.1** mit einer Schutzschicht versehen wird. Diese Schutzschicht kann eine Lackschicht, eine Pulverbeschichtung, eine DLC-Schicht oder eine Metallschicht sein.

[0062] Die Erfindung ist beispielhaft anhand eines einspurigen inkrementalen Maßstabs **1** bzw. **1.1** erläutert. Die Erfindung ist auch bei mehrspurigen inkrementalen sowie bei absoluten Maßstäben realisierbar. Ein absoluter Maßstab kann dabei einspurig in Form eines sogenannten PRC-Codes oder Kettencodes ausgeführt sein, als mehrspuriger Code mit mehreren nebeneinander angeordneten Inkrementalspuren unterschiedlicher Teilungsperiode, beispielsweise in Form eines Gray-Codes oder als sogenanntes Vernier-System mit mehreren nebeneinander angeordneten Inkrementalspuren mit nur geringfügig unterschiedlichen Teilungsperioden.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- EP 0743508 A2 [[0004](#), [0004](#), [0005](#)]

Patentansprüche

1. Maßstab mit einer induktiv abtastbaren Teilung, bestehend aus einer in Messrichtung (X) angeordneten Folge von Teilungselementen (12), wobei der Maßstab (1, 1.1) einen Schichtstapel (10, 10.1) umfasst, der aus einer Abfolge von metallischen Schichten (101, 102, 103, 104) besteht, und dass diese Abfolge von metallischen Schichten (101, 102, 103, 104) zumindest eine Trägerschicht (102) und eine die Teilungselemente (12) bildende Teilungsschicht (101) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass die Trägerschicht (102) zwischen der Teilungsschicht (101) und einem metallischen Substrat (103) angeordnet ist, wobei das Substrat (103) derart dimensioniert ist, dass es die mechanischen Eigenschaften des Schichtstapels (10, 10.1) maßgebend bestimmt, und dass die Trägerschicht (102) ein ferromagnetisches Metall ist.

2. Maßstab nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Trägerschicht (102) ein weichmagnetisches Metall ist.

3. Maßstab nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Trägerschicht (102) ein Metall ist mit einer Permeabilität μ_r größer 200, insbesondere größer 1000 ist.

4. Maßstab nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Material der Teilungsschicht (101) eine Permeabilität μ_r von annähernd 1 aufweist, insbesondere zumindest eines der Metalle Kupfer, Aluminium, Gold oder Silber enthält.

5. Maßstab nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Substrat (103) aus Edelstahl besteht.

6. Maßstab nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke des Substrats (103) ein Vielfaches der Dicke der Trägerschicht (102) beträgt.

7. Maßstab nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Seite des Substrats (103) die Schichtenfolge Trägerschicht (102) und Teilungsschicht (101) vorgesehen ist, und dass auf der anderen Seite des Substrats (103) zumindest eine Kompensationsschicht (104) vorgesehen ist, die einer Durchbiegung des Schichtstapels (10, 10.1) hervorgerufen durch den Bimetalleffekt entgegenwirkt.

8. Maßstab nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kompensationsschicht (104) aus einem ferromagnetischen Metall besteht.

9. Maßstab nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichten (101, 102, 103, 104) des Schichtstapels (10.1) mittels Walzplattieren miteinander verbunden sind.

10. Maßstab nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichten (101, 102, 103, 104) des Schichtstapels (10, 10.1) mittels Kaltwalzplattieren miteinander verbunden sind.

11. Positionsmesseinrichtung mit einem Maßstab (1, 1.1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und mit einer Abtasteinheit (2) zur Abtastung der Teilungselemente (12) des Maßstabs (1), wobei die Abtasteinheit (2) eine Erregereinheit (21) zur Erzeugung eines elektromagnetischen Wechselfeldes und eine Detektoreinheit (22) zur Detektion des von den Teilungselementen (12) positionsabhängig modulierten elektromagnetischen Wechselfeldes aufweist.

12. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Erregereinheit von zumindest einer flächigen Erregerwindung (21) und die Detektoreinheit von zumindest einer flächigen Abtastwindung (22) gebildet ist.

13. Positionsmesseinrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Seite des Substrats (103) die Schichtenfolge Trägerschicht (102) und Teilungsschicht (101) vorgesehen ist, auf der anderen Seite des Substrats (103) zumindest eine Kompensationsschicht (104) aus ferromagnetischem Material vorgesehen ist, und die Abtasteinheit (2) eine Abschirmung (7) aufweist, wobei die Abschirmung (7) derart ausgebildet ist, dass diese mit der Kompensationsschicht (104) einen Magnetkreis (8) ausbildet.

14. Verfahren zur Herstellung eines Maßstabs (1, 1.1) mit einer in Messrichtung (X) angeordneten Folge von Teilungselementen (12) durch Bilden eines Schichtstapels (10, 10.1), der aus einer Abfolge von metallischen Schichten (101, 102, 103, 104) besteht, wobei der Schichtstapel (101, 102, 103, 104) zumindest eine Trägerschicht (102) und eine die Teilungselemente (12) bildende Teilungsschicht (101) aufweist, **dadurch gekennzeichnet**, dass ein Verbund mit der Schichtfolge metallisches Substrat (103), Trägerschicht (102) und Teilungsschicht (101) geschaffen wird, wobei das Substrat (103) derart dimensioniert ist, dass es die mechanischen Eigenschaften des Verbundes des Schichtstapels (10, 10.1) maßgebend bestimmt, und dass als Trägerschicht (102) ein ferromagnetisches Metall verwendet wird.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass als Trägerschicht (**102**) ein weichmagnetisches Metall verwendet wird

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass als Trägerschicht (**102**) ein Metall mit einer Permeabilität μ_r größer 200, insbesondere größer 1000 verwendet wird.

17. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass der Schichtstapel (**10**, **10.1**) aus Metallbändern besteht, die mittels Walzplattieren miteinander verbunden werden.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass das Walzplattieren ein Kaltwalzplattieren ist.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Teilungselemente (**12**) gebildet werden, indem die Teilungsschicht (**101**) nach dem Walzplattieren strukturiert wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Anhängende Zeichnungen

FIG. 1

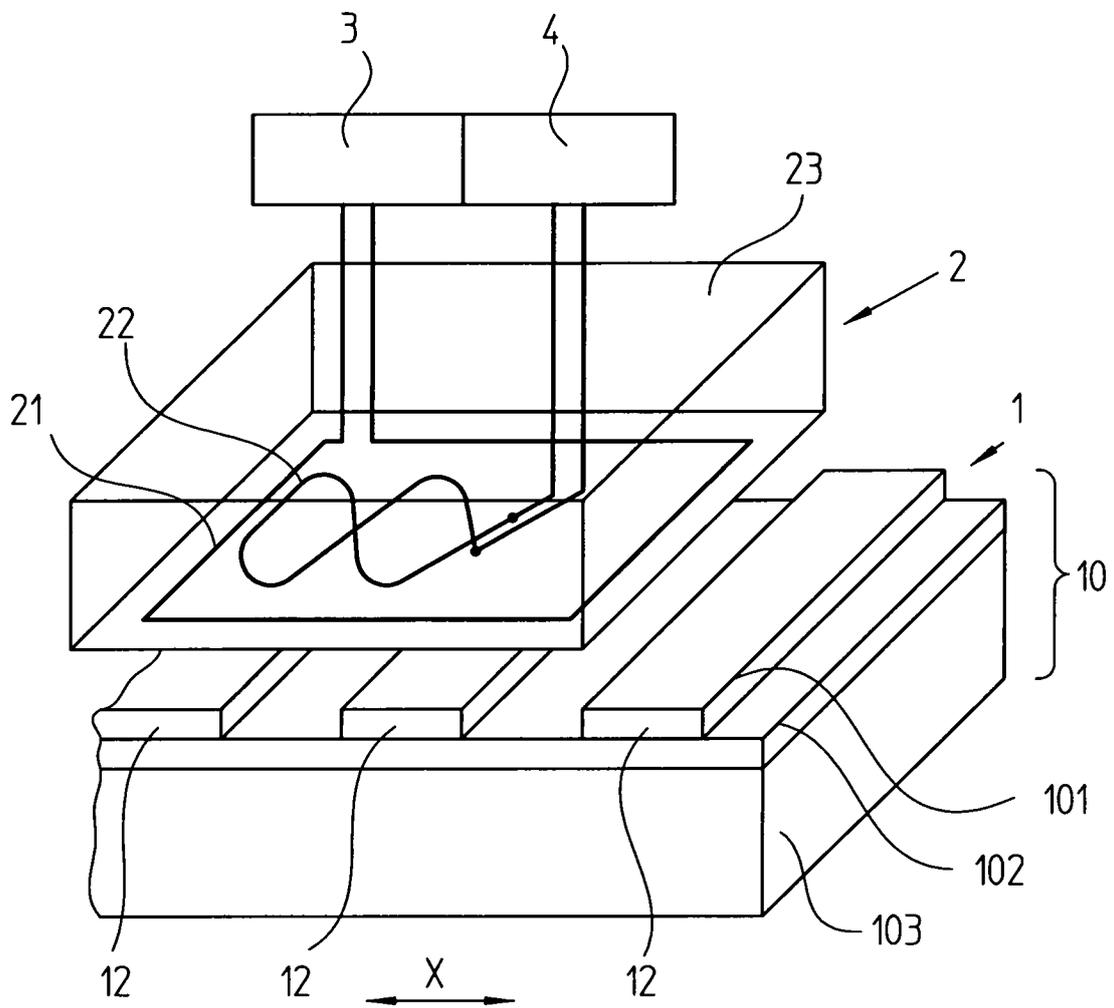


FIG. 2

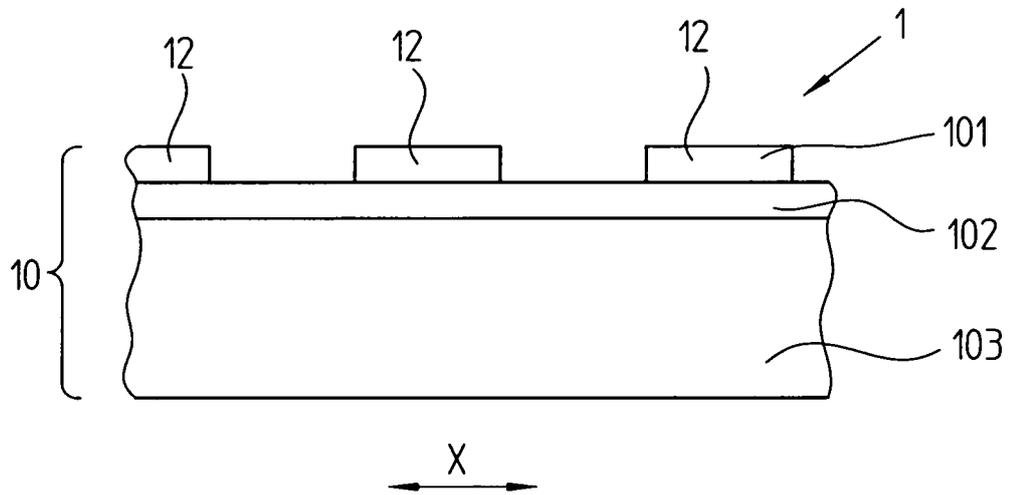


FIG. 4

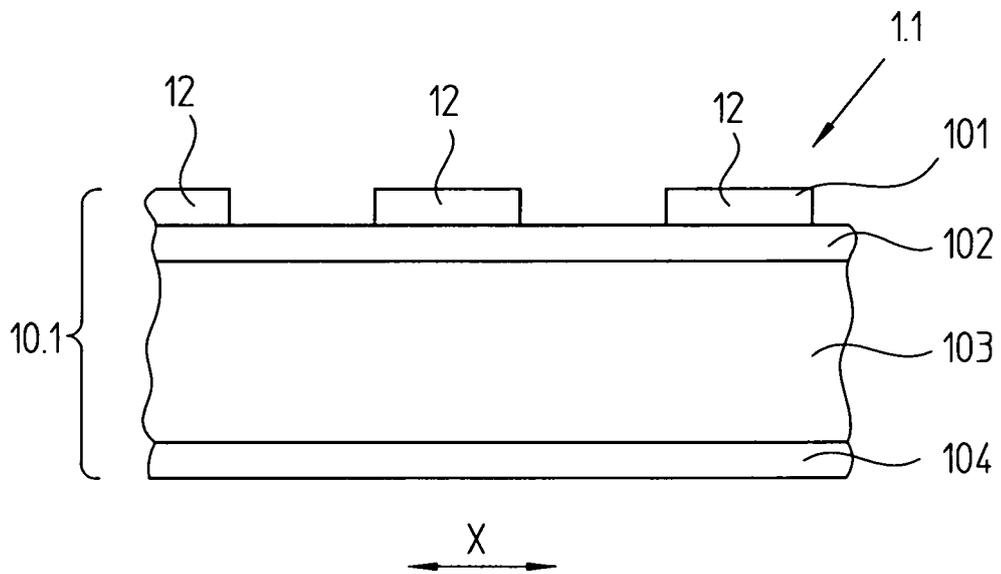


FIG. 3a

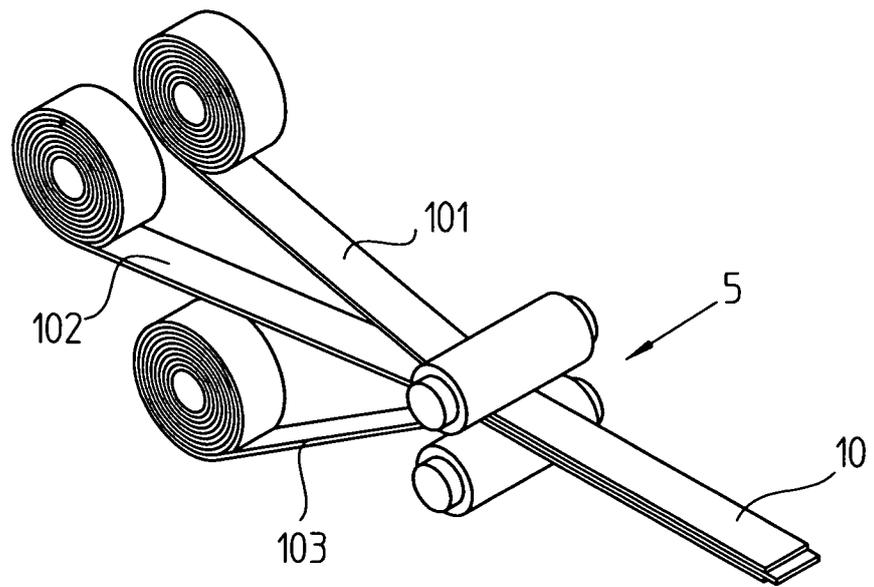


FIG. 3b

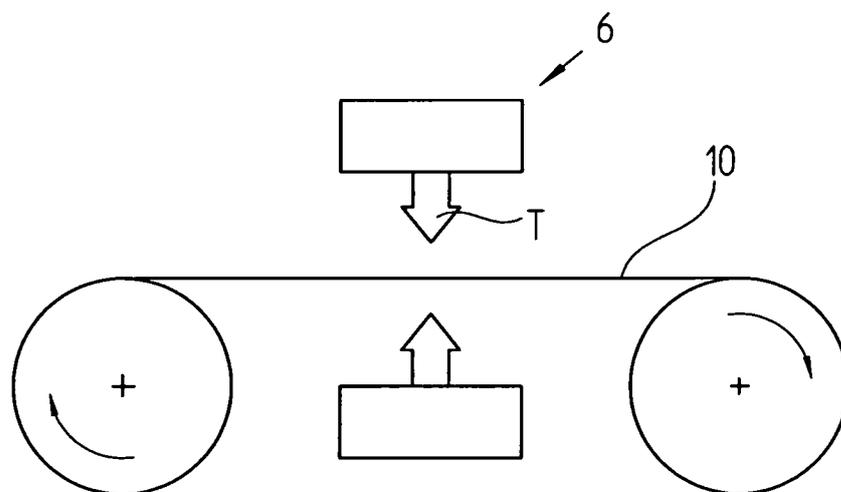


FIG. 5

